経常研究

三次元座標測定機を用いた曲面形状測定に関する研究

片岡 智史* 渡部 篤彦* 石川 信幸*

Research on Measurement of Curved Surface using Coordinate Measuring Machine KATAOKA Satoshi, WATANABE Atsuhiko and ISHIKAWA Nobuyuki

三次元座標測定機の測定子の接触方向による滑りの影響を調査するため、ブロックゲージや曲面形状を有するワークで検証を行った。100mmのブロックゲージを点測定し、接触角度を変化させたときの2点間の距離を求めた。接触角度が大きくなると、2点間の空間距離は測定子の滑りの影響を受けるが、ブロックゲージの長さ方向の距離は滑りの影響を受けないことがわかった。曲面形状を有するワークを作製し、測定子を法線方向から接触させた場合と、垂直方向から接触させた場合の点の座標値を比較し、垂直方向接触の場合の滑り量を求めた。結果として、斜面の角度が大きくなるほど測定子の滑り量は大きくなり、斜面角度70°では、約250µmの滑りが発生することが明らかになった。

Key words: 精密測定,三次元座標測定機,タッチ測定,曲面形状,誤差

1 はじめに

近年,航空機部品や金型部品において曲面形状を有する部品が増加し,部品製造を行う加工メーカにおいても曲面形状の精度検証の要求が増加している¹⁾。

当センターでは、このような要求を受けた企業に対し て、非接触三次元デジタイザやX線CTなど非接触の装置 で測定支援を行っている。曲面形状を非接触で測定する メリットとしては, 曲面形状全体の点群データが得られ ることがあげられる2)。一方で、非接触の装置の測定精 度は最小で約10μmと高精度な測定はできないことがデ メリットであった。非接触の測定機よりも高い精度で測 定したいという要求から, 三次元座標測定機を用いて曲 面形状を測定するケースが増加している。三次元座標測 定機は測定点が離散点となるので, 非接触の測定機のよ うに曲面形状全体の点群データを取得することは難し いが, 非接触の測定機よりも高い精度で測定が可能であ る。三次元座標測定機で曲面形状を測定する場合の課題 として, 測定子が測定面に対して法線方向以外から接触 した場合に, 測定子の滑りが測定結果に影響を及ぼすこ とが考えられる³⁾。

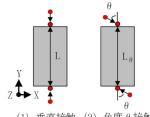
そこで本研究ではブロックゲージや曲面形状を有するワークを測定し、測定子の接触方向による滑りの影響について調査を行った。

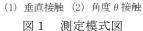
* 栃木県産業技術センター 機械電子技術部

2 研究の方法

2. 1 ブロックゲージを用いた滑り検証

ブロックゲージの測定において, 測定子の接触角度 θ が, 測定値にどのような影響を及ぼすか検証した。測定 の模式図を図1に、測定セットアップを図2に示す。三 次元座標測定機はミツトヨ製 LEGEX9106 を使用した。ブ ロックゲージを三次元座標測定機の Y スケールに沿っ て配置し,ブロックゲージの2面を点測定した。測定し た2点間の距離からブロックゲージの長さを求めた。接 触角度 0°は、測定子は図1(1)のように測定面に対し て垂直に接触する。接触角度θは、図1(2)に示す角度 θ方向から接触する。ブロックゲージはミツトヨ製の長 さ 100mm のものを使用した。使用したブロックゲージの 仕様を表1に示す。測定条件を表2に示す。測定子は直 径 2mm のものを使用した。接触角度 θ は 0, 15, 30, 45, 60, 75°の6条件で測定を行った。ブロック ゲージの長さを算出する際は, 測定面と接触子の接触位 置による誤差を取り除くために、半径補正なしでデータ を出力した。





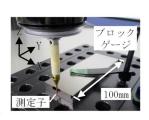


図2 測定セットアップ

表1 ブロックゲージ仕様

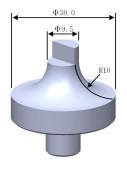
メーカ	株式会社ミツトヨ
製造番号	No. 184655
ブロックゲージ等級	K 級
呼び寸法	100mm
中央寸法の寸法差	+0.097µm
校正年月日	2022年10月

表 2 測定条件

測定子	直径2mm,鉛直方向
接触角度	0, 15, 30, 45, 60, 75°
半径補正	なし

2. 2 曲面形状ワークを用いた滑り検証

曲面形状を有するワークを点測定するときの測定子 の滑りの影響について検証した。まず測定に用いるワー クの設計・加工を行った。製作したワークを図3に示す。 φ30mmの丸棒を旋盤で加工し、R10の曲面形状を生成し た。測定の際の表面粗さの影響を小さくするために、旋 盤加工後に金属磨きで研磨を行い、表面粗さ RaO.05µm, Rz0.17µm とした。測定の模式図を図4に、測定条件を表 3に示す。接触位置 X に対して(1) 法線方向から接触 する場合と、(2) 垂直方向から接触する場合でそれぞれ 点測定を行い, 法線方向接触の座標値から垂直方向接触 の座標値を減算することで, 垂直方向接触の場合の滑り 量を求めた。接触位置 X は, X=5.5~14.5の範囲で, 1mm ピッチで測定を行った。ブロックゲージの測定と同様に, 測定面と接触子の接触位置による誤差を取り除くため に、半径補正なしでデータを出力した。測定セットアッ プを図5に示す。図5(a)は三次元座標測定機の機械座 標系を示している。測定時のプローブ駆動面による影響 を調査するため、測定する断面を機械座標系の ZX 平面 に一致させた場合(図5(b))と, XY 平面に一致させた 場合(図5(c))の2パターンで測定を行った。



Ra 0.05 Rz 0.17

(a) ワーク3Dモデル

ル (b) ワーク写真

図3 曲面形状ワーク

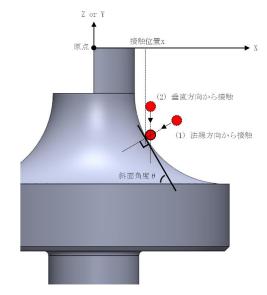


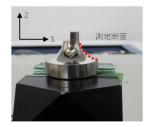
図4 ワーク測定模式図

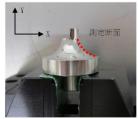
表 3 測定条件

測定子	直径 2mm, 鉛直方向	
接触位置	X=5.5~14.5 の範囲で 1mm ピッチ	
接触方向	測定面の法線方向, 垂直方向	
半径補正	なし	



(a) 三次元座標測定機の機械座標系





(b) ZX 平面での測定(c) XY 平面での測定図 5 測定セットアップ

3 結果及び考察

3. 1 ブロックゲージを用いた滑り検証の結果

図6に測定子の接触角度に対するブロックゲージの測定値をプロットしたグラフを示す。2点間の空間距離は、接触角度30°までは、垂直に接触する場合と比較してほぼ同じ値であったが、接触角度45°を超えると増大した。これは図7に示すように、測定面接触時に測定子が滑り、ブロックゲージの長さを斜めに測定していることが原因と考えられる。一方でY方向の2点間距離については、2点間の空間距離で確認された滑りの影響はなく、接触角度が大きくなっても一定であった。すなわちブロックゲージのような直方体の長さを測定する場合、2点間の空間距離は滑りの影響を受けてしまうが、2点間の測定方向に対する距離(この測定ではY方向)を算出すれば、滑りの影響のない測定結果を得ることができる。

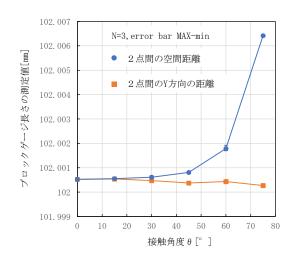


図6 ブロックゲージ測定結果

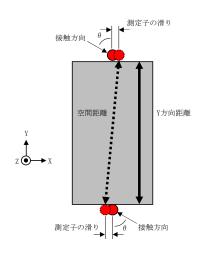
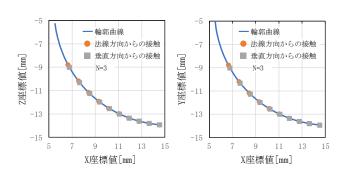


図7 測定結果の考察

3.2 曲面形状ワークを用いた滑り検証の結果

点測定した座標値をプロットしたグラフを図8に示 す。図8の曲線は倣い測定で取得した測定断面の輪郭曲 線を示している。図8(a), (b)のいずれの場合にお いても, 測定点の座標値は輪郭曲線上に存在するが, 接 触する面が急角度であるほど, 法線方向接触の場合と垂 直方向接触の差が大きくなり, 垂直方向から接触した点 は法線方向から接触した点と比較して測定子が接触方 向に進みすぎていることが読み取れる。これは垂直接触 において測定子の滑りが発生したことが原因と考えら れ,接触する面が急角度であるほど滑り量は大きくな る。図9に横軸に測定面の斜面角度を、縦軸に滑り量を プロットしたグラフを示す。図9から斜面角度約70°の 斜面では滑り量が約 250 μm になることが明らかになっ た。また、斜面角度が3°の面に接触した場合でも10~ 20µm ほどの滑りが発生していることがわかった。以上か ら,三次元座標測定機を用いて曲面形状の点測定を行う 場合, 測定子の接触方向が測定面の法線方向からわずか でもずれると、誤差の要因になると考えられる。



(a) ZX 平面測定結果 (b) XY 平面測定結果 図 8 曲面形状ワーク測定結果

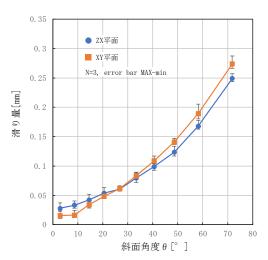


図9 斜面角度に対する滑り量の変化

4 おわりに

ブロックゲージや曲面形状を有するワークを測定し、 測定子の接触方向による滑りの影響について以下の知 見を得た。

- (1) ブロックゲージの長さ測定において、接触角度が大きくなると、2 点間の空間距離は測定子の滑りの影響を受ける。一方で、ブロックゲージの長さ方向の2 点間距離は滑りの影響を受けない。
- (2) 曲面形状を点測定する場合,測定面に対して測定子を垂直方向から接触させた場合では,法線方向から接触させた場合と比較して,測定子の滑りによって座標値に誤差が生じる。約70°の斜面では約250μmの誤差が生じ、3°の斜面でも10~20μmの誤差が生じる。

(3) 三次元座標測定機を用いて曲面形状の点測定を行 う場合,測定子の接触方向が測定面の法線方向に 対してわずかでもずれると,測定誤差の要因にな る。

参考文献

- 1) 渡邉真莉: "計測と制御", 61 巻, 10 号, 762-769, (2022)
- 2) 赤羽孝彦: "精密工学会", 85 巻, 5 号, 396-400, (2019)
- 3) 岸浪建史,中村久,斎藤勝政,亀井明敏:"精密工学会誌",52巻,8号,1420-1425,(1986)